

ナノ構造解析グループ装置利用料金表 (NIMS内部)

2021.04.01

装置名	利用形態	課金単位 (機器利用・技術補助)	利用料金 (1hあたり) 税別				
			機器利用	技術補助	技術代行1	技術代行2	技術代行3
実動環境対応物理分析電子顕微鏡 JEM-ARM200F-G	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション(3.5h)	4,000	6,100	6,310	8,200	10,300
実動環境対応電子線ホログラフィー電子顕微鏡 JEM-ARM200F-B	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション(3.5h)	4,000	6,100	6,310	8,200	10,300
300kV電界放出形透過電子顕微鏡 Tecnai G2 F30	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション(3.5h)	3,000	5,100	5,310	7,200	9,300
200kV電界放出形透過電子顕微鏡 JEM-2100F1, JEM-2100F2	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション(3.5h)	2,000	4,100	4,310	6,200	8,300
200kV透過電子顕微鏡 JEM-2100	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション(3.5h)	1,000	3,100	3,310	5,200	7,300
走査電子顕微鏡 JSM-7000F	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション(3.5h)	1,000	3,100	3,310	5,200	7,300
デュアルビーム加工観察装置 NB5000	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション(3.5h)	3,000	5,100	5,310	7,200	9,300
FIB加工装置 JIB-4000, JEM-9320FIB	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション(3.5h)	1,000	3,100	3,310	5,200	7,300
FIB加工装置 ピックアップシステム	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	時間(0.25h)	1,000	3,100	3,310	5,200	7,300
ウルトラマイクローム Leica EM UC6	技術補助・技術代行 共同研究	時間(1h)	1,000	3,100	3,310	5,200	7,300
HRTEM解析システム	技術補助・技術代行 共同研究	時間(1h)	—	3,100	3,310	5,200	7,300
電子線トモグラフィー解析システム	技術補助・技術代行 共同研究	時間(1h)	—	3,100	3,310	5,200	7,300
DPC解析システム	技術補助・技術代行 共同研究	時間(1h)	—	3,100	3,310	5,200	7,300
TEM試料作製装置群	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	時間(1h)	1,000	3,100	3,310	5,200	7,300

その他の支援	利用形態	課金単位	利用料金 (1hあたり) 税別
解析	技術代行	時間(0.25h)	2,100
技術指導料	技術補助	時間(0.25h)	2,100

※お支払いの所管(配算体)にかかわらず消費税が加算されます
 ※技術代行の料金設定は、難易度によって3種類に分かれています
 標準的な作業の場合は2が適用されます